Kraftmesslager

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Wälzlager mit angeordneten Sensoren, mit denen die aktuelle Belastung des Wälzlagers ermittelt werden kann.

In der US 5,952,578 sind solche Kraftmesslager beschrieben. In der Figur 10b dieser Schrift ist dargestellt, wie bei einem Kegelrollenlager, die von den Sensoren gemessene Kraft (Materialdehnung) in Radialkräfte und Axialkräfte aufgeteilt wird. Das Problem dieser Lösung besteht darin, dass zur Zerlegung der Kräfte in Radial- und Axialkräfte der Laufbahnwinkel konstant sein muss. Für Wälzlager mit gekrümmten Laufbahnen, wie z. B. Rillenkugellager ist das beschriebene Verfahren nicht anwendbar, um die auf das Wälzlager wirkenden Axial- oder Radialkräfte mit Sensoren, die gegenüber den Laufbahnen angeordnet sind, zu ermitteln.

Aufgabe der Erfindung

Es besteht also die Aufgabe, eine Sensoranordnung für Wälzlager mit gekrümmten Laufbahnen aufzuzeigen, bei denen sich die gemessenen Kräfte eindeutig in Axialund Radialkräfte zerlegen lassen.

Beschreibung der Erfindung

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst.

Der Kern der Erfindung besteht darin, dass Sensoren (z. B. DMS – Sensoren) am Außendurchmesser des Außenringes bzw. am Innendurchmesser des Innenringes angeordnet werden, die bei Belastung (Hertz'sche Pressung) der Ringe durch die Wälzkörper je nach axialer Lage in den Laufbahnen des Wälzlagers unterschiedlich lange Zeitsignale erzeugen. Die unterschiedlich langen Signale werden dadurch er-

zeugt, dass die Länge zweier benachbarter in Umfangsrichtung liegender Leiterbahnabschnitte des DMS - Sensors variiert. Die unterschiedlich langen Zeitsignale bei Belastung sind also proportional zum Kontaktwinkel der Wälzkörper in der Laufbahn der Wälzlagerringe. Bei dieser Anordnung der DMS - Sensoren wird der Effekt genutzt, dass bei Wälzlagern mit gekrümmten Laufbahnen die Wälzkörper bei einer kombinierten Radial - Axialbelastung aus dem Laufbahngrund sich heraus bewegen und eine neue Gleichgewichtslage außerhalb des Laufbahngrundes einnehmen. Je höher die Axialbelastung wird, desto weiter weicht der Wälzkörper aus dem Laufbahngrund Richtung Seitenfläche des Wälzlagers. Damit verschiebt sich auch die Druckellipse zwischen Wälzlagerring und Wälzkörper in axialer Richtung. Die Druckellipse führt auch zu einer Längenveränderung in Umfangsrichtung im Material des Wälzlagerringes. Die Sensoren, die in axialer Richtung unterschiedlich breit sind, erfassen somit die Längenveränderung im Material - beim Durchrollen des Wälzkörpers - unterschiedlich lang. Die Länge der Belastung eines Sensors kann über die Kenntnis der Geometrie des Wälzlagers in radiale und axiale Kräfte umgerechnet werden.

Da die Belastungsdauer eines Sensors auch von der Drehzahl des Wälzlagers abhängig ist, wird über den Zeitabstand, den zwei benachbarte Wälzkörper benötigen, um einen Sensor zu belasten, die Drehzahl ermittelt.

Der Vorteil von Anspruch 3 besteht darin, das bei dieser Anordnung handelsübliche rechteckige DMS - Sensoren eingesetzt werden können.

Beschreibung der Figuren

Die Erfindung wird anhand von 6 Figuren beschrieben.

In der Figur 1 wird ein Wälzlager mit gekrümmten Laufbahnen (hier ein Rillenkugellager) dargestellt. Der Wälzkörper 1 ist zwischen den beiden Laufringen 2 und 3 angeordnet. In dieser Darstellung befindet sich der Wälzkörper genau in der mittleren Lage des Wälzlagers. Bei Belastung wandert dieser Wälzkörper in axialer Richtung zur Seitenfläche 2a oder 2b des Wälzlagers, wobei dies von der Kraftrichtung der axialen Kräfte abhängt. Die Sensoren 4 sind in diesem Beispiel in einer Nut 5 am Außenring 2 angeordnet. Nicht dargestellt ist die analoge Anordnung der Sensoren 4 in einer Nut am Innenring 3.

Die Figuren 2 bis Figur 5 zeigen spezielle Sensoranordnungen, die in der Nut 4 am Außenring 2 und/oder am Innenring 3 angeordnet sind. Um die Anordnung der Sensoren besser zu erkennen, sind die Wälzlagerringe abgewickelt dargestellt. Die Sensoren 4 sind hier in der bevorzugten Ausführungsform eines Dehnungsmess-Streifens in trapezförmiger Anordnung dargestellt. Die Leiterbahnabschnitte des DMS-Sensors 4a bzw. 4b sind in axialer Richtung 6 unterschiedlich lang ausgeführt. Aus dieser Darstellung wird sofort deutlich, dass ein Wälzkörper, der sich in axialer Richtung 6 aus dem Laufbahngrund heraus sich bewegt, die Sensoren 4 unterschiedlich lang (zeitlich) belastet. Die Länge des Zeitsignals eines Sensors ist somit proportional zur Winkellage des Wälzkörpers 1 in den Wälzlagerringen 2 oder 3. Da die Sensoren 4 normalerweise zu Wheatstone -Brücken verschaltet werden, ist die Dauer des Ausgangssignals der Wheatstone - Brücke somit proportional zum Kontaktwinkel des Wälzkörpers 1 in der Laufbahn der Wälzlagerringe 2 oder 3. Eine bevorzugte Ausführungsform stellt hierbei die Anordnung der DMS – Sensoren in einem Abstand im Wälzlagerring dar, der dem halben Abstand zweier benachbarter Wälzkörper entspricht.

In der Fig. 2b sind die Ausgangssignale der Wheatstone – Brücke für den Fall dargestellt, dass der Wälzkörper im Bereich der kurzen Leiterbahnabschnitte 4a unter dem DMS - Sensor hindurchrollt. Die Lage der unter den Sensoren hindurchrollenden Wälzkörper ist mit dem Pfeil 10 gekennzeichnet. Die Periodendauer 8a der Signale ist entsprechend kurz.

In der Fig. 2c sind die Ausgangssignale der Wheatstone – Brücke für den Fall dargestellt, dass der Wälzkörper im Bereich der langen Leiterbahnabschnitte unter dem DMS - Sensor hindurchrollt. Die Lage der unter den Sensoren hindurchrollenden Wälzkörper ist mit dem Pfeil 11 gekennzeichnet. Die Periodendauer 8b der Signale ist entsprechend lang. Die Periodendauer ist bei bekannter Drehzahl des Wälzlagers also proportional zur Winkellage der Wälzkörper in der Laufbahn.

Bei der Sensoranordnung in der Figur 3 wird die Winkellage der Wälzkörper in der Laufbahn durch eine Mittelwertbildung der langen und kurzen Periodendauer im Ausgangssignal der Wheatstone - Brücke ermittelt. In der Figur 3a ist das Ausgangssignal der Wheatstone - Brücke dargestellt. Die abwechselnde Periodendauer 8c ist gekennzeichnet.

Bei den Sensoranordnungen in der Figur 4 und 5 ist der Zeitabstand zwischen dem Belasten werden zweier benachbarten Sensoren 4c, 4d proportional zur Winkellage des Wälzkörpers 1 in den Laufbahnen 2c, 3c der Wälzlagerringe 2 oder 3. Die Figuren 4 und 5 unterscheiden sich durch unterschiedlich orientierte Leiterbahnabschnitte in den Sensoren (DMS-Sensoren) 4c und 4d. Nicht dargestellt ist der vergleichbare Fall mit Einsatz handelsüblicher DMS-Sensoren mit rechtwinkeliger Grundfläche.

In der Figur 6 ist ein Ausschnitt des Wälzlagerringes mit den Sensoren 4 dargestellt. Der Wälzkörper 1 ist in unterschiedlichen Lagen in der Laufbahn gezeichnet. Das vom Sensor 4 (eines Sensors der Wheatstone - Brücke) ermittelte Signal ist unterhalb des Ausschnittes des Wälzlagerringes abgebildet. An der Ordinate des Koordinatensystems ist die Widerstandsänderung (ΔR/R) im Sensor 4 und an der Abszisse ist die Zeit (t) aufgeführt. Die unterschiedliche Periodendauer 8 in Abhängigkeit von dem Kontaktwinkel der Wälzkörper in der Laufbahn der Wälzlagerringe wird in dieser Darstellung deutlich. Die Höhe des Signals 9 ist proportional zur Belastung des Wälzlagerringes.

5

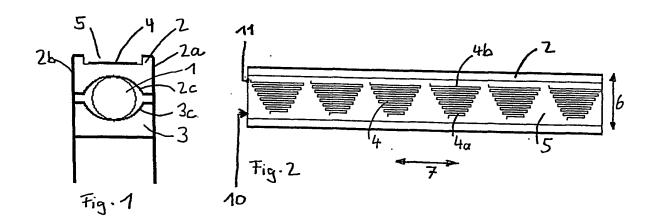
Bezugszeichenliste

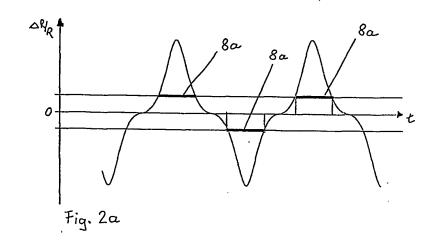
ı	vvalzkorper
2	Außenring
2a, 2b	Seitenfläche des Außenringes
2c	Laufbahn des Außenringes
3	Innenring
3c	Laufbahn des Innenringes
4	Sensoren
4a, 4b	unterschiedlich lange Leiterbahnen des Sensors
4c, 4d	Sensoren gleicher Breite
5	Nut im Außen- oder Innenring
6	axiale Richtung des Wälzlagers
7	Umfangsrichtung des Außen- oder Innenringes
8	Periodendauer des Signals
8a	Kurze Periodendauer des Signals
8b	Lange Periodendauer des Signals
8c	Kurze und lange Periodendauer aufeinanderfolgend im Signal der
	Wheatstone - Brücke
9	entspricht der Dehnung des Materials und ist proportional zur Höhe der Be-
	lastung des Wälzlagerringes
10, 11	Lage der unter dem Sensor hindurchrollenden Wälzkörper

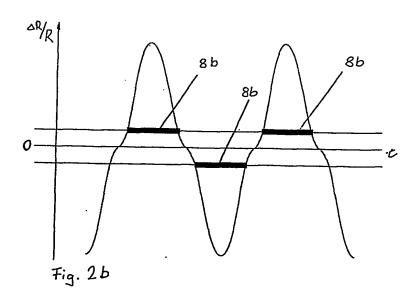
Kraftmesslager

Ansprüche

- Wälzlager mit gekrümmten Laufbahnen (2c, 3c) und dazwischen angeordneten Wälzkörpern (1) und DMS Sensoren (4), die in einer Nut (5) am Außendurchmesser des Außenrings (2) und / oder am Innendurchmesser des Innenrings (3) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge zweier benachbarter Leiterbahnabschnitte des DMS Sensors variiert.
- Wälzlager mit gekrümmter Laufbahn nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die benachbarten Leiterbahnabschnitte so angeordnet sind, dass der DMS Sensoren (4) trapezförmig ausgeführt sind.
- Wälzlager mit gekrümmten Laufbahnen (2c, 3c) und dazwischen angeordneten Wälzkörpern (1) und Sensoren (4), die in einer Nut (5) am Außendurchmesser des Außenrings (2) oder Innendurchmesser des Innenrings (3) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen zwei benachbarten Sensoren (4c, 4d) in axialer Richtung (6) variiert.







BEST AVAILABLE COPY

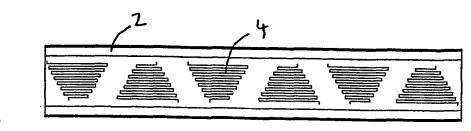
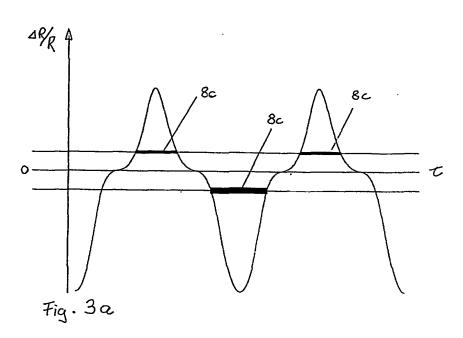
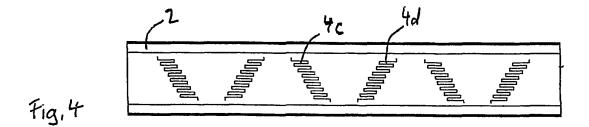


Fig.3





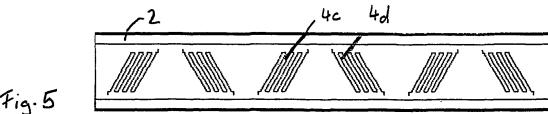
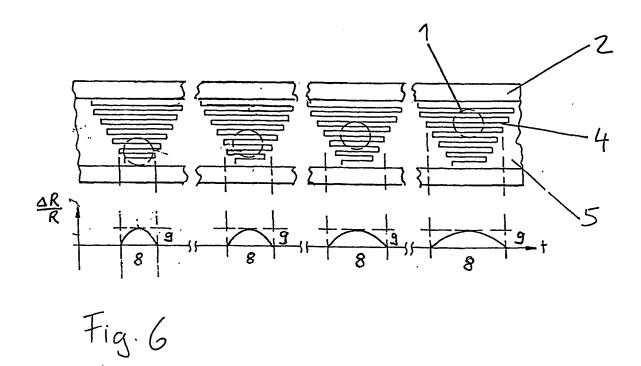


Fig. 5



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermional Application No PCT/DE 03/03829

			101/02 03/03629	
A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G01L5/00 G01M13/04			
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ation and IPC		
B. FIELDS				
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification \$4.000 GOOM)	on symbols)		
	ion searched other than minimum documentation to the extent that s			
	ata base consulted during the International search (name of data bas ternal, WPI Data, PAJ, INSPEC	se and, where practical	, search terms used)	
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.	
А	US 4 203 319 A (LECHLER GERHARD B 20 May 1980 (1980-05-20) abstract; figure 1	3)	1-3	
	ner documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family r	nembers are listed in annex.	
"A" docume conside the considering of the consequence which is citation." O" docume other no later the consequence	ant defining the general state of the art which is not eared to be of particular relevance to current but published on or after the international attention of the control	 'T' tater document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention 'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. '&' document member of the same patent family 		
_	April 2004	Date of mailing of t 15/04/2	ne International search report	
Name and m	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-3016, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Zafirop	oulos, N	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

infectional Application No PCT/DE 03/03829

		into mation on patent family members				PCT/DE 03/03829		
Pat cited	ent document in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date	
US	4203319	Α	20-05-1980	DE	274693	7 A1	19-04-1979	
					•			
_								

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2004)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interiona	les Aktenzeicher
PCT/DF	03/03829

T			101/01 03/03029				
IPK 7	IFIZIERUNG DES ANMELDUNGSŒGENSTANDES G01L5/00 G01M13/04						
Nach der In	dernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kl	assifikation und der IPK					
	RCHIERTE GEBIETE						
1PK 7	nter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymi GO1L GO1M						
	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s						
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und	evtl. verwendete Suchbegriffe)				
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, INSPEC						
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angal	be der in Betracht komme	nden Teile Betr. Anspruch Nr.				
Α	US 4 203 319 A (LECHLER GERHARD 20. Mai 1980 (1980-05-20) Zusammenfassung; Abbildung 1	в)	1-3				
Weite entre	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang P	atentfamille				
° Besondere	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	T Spätere Veröffentlicht	ing, die nach dem internationalen Anmeldedatum				
anei ili	tlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, cht als besonders bedeutsarn anzusehen ist	Anmeidung nicht koll	atum veromentschi worden ist und mit der idlert, sondern nur zum Verständnis des der				
Anmeid	E' âlteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist **Y Veröffentlichung von besonderen Bodeutung die begranden Erfindung zugrundellegenden Frinzips oder der ihr zugrundellegenden **Y Veröffentlichung von besonderen Bodeutung die begranden Erfindung zugrundellegenden Frinzips oder der ihr zugrundellegenden **Y Veröffentlichung von besonderen Bodeutung die begranden Erfindung zugrundellegenden Frinzips oder der ihr zugrundellegenden **Y Veröffentlichung zugrun						
"L" Veröffen scheine andere soll ode ausgef	**L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- schelnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausoeffint) **L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- schelnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung die besonderen Bedeutung; die beanspruchte Erfindung in veröffentlichung von besonderen Bedeutung; die beanspruchte Erfindung in veröffentlichung von besonderen Bedeutung; die beanspruchte Erfindung in veröffentlichung von besonderen Bedeutung; die beanspruchte Erfindung von besonderen Bedeutung; die beanspruchte Erfindung veröffentlichung von besonderen Bedeutung; die beanspruchte Erfindung von besonderen Bedeutung die beanspruchte Erfindung von besonderen Bedeutung die begreten bedeutung die begreten besteht die der der der der der der der der der de						
"P" Veröffen	illichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, nutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach anspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	veromentlichungen di diese Verbindung für	röffenllichung mit einer oder mehreren anderen eser Kategorte in Verbindung gebracht wird und einen Fachmann nahellegend ist Altglied derselben Patentfamille ist				
	bschlusses der Internationalen Recherche		nternationalen Recherchenberichts				
	April 2004	15/04/20	04				
Name und Po	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevollmächtigter Bed	lensteter				
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel (+31–70) 340–2040, Тх. 31 651 epo nt,						
	Fax: (+31-70) 340-3016	Zafiropo	ulos, N				

Formblait PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Jenuar 2004)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Interponales Aktenzelchen
PCT/DE 03/03829

						PCT/DE 03/03829	
	echerchenbericht tes Patentdokume	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US	4203319	Α	20-05-1980	DE	2746937	A1	19-04-1979
			— 				
	•						